

**Thesis Title Development of High Energy Metal Vapor Vacuum Arc
Ion Source for Establishment of Ion Implantation
Technology**

Author Mr. Yeelord Chutopa

Degree Doctor of Philosophy (Physics)

Thesis Advisory Committee

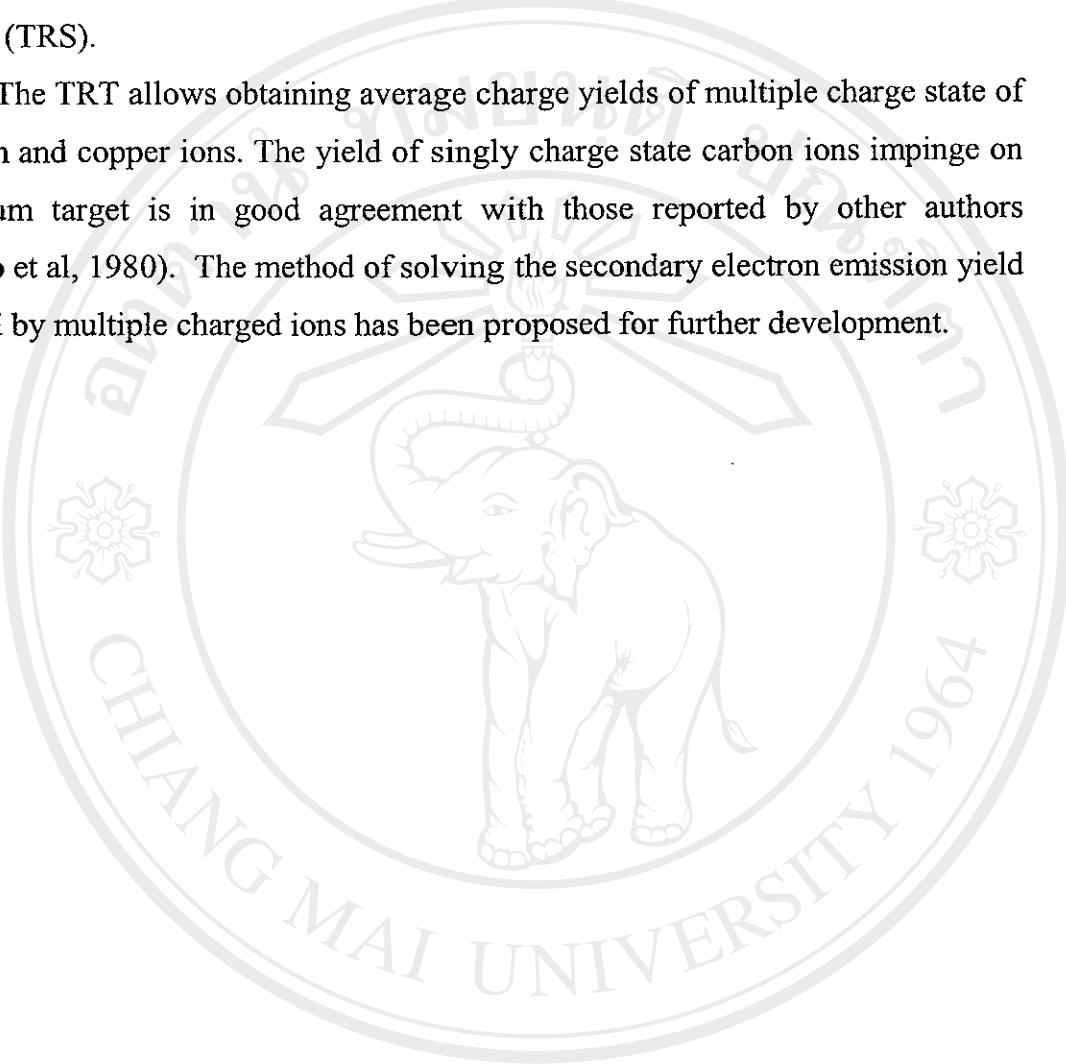
Asst. Prof. Dr. Bunchob Yotsombat	Chairperson
Assoc. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul	Member
Dr. Yu Liangdeng	Member

ABSTRACT

We describe the characteristic of the high energy Metal Vapor Vacuum Arc (MEVVA) ion source for determination of the optimum perveance match condition and a new method for the measurement of secondary electron emission yields. The source was used to produce metal ions for the measurement of the secondary electron emission yields induced by the bombardment of carbon, titanium and copper ions onto an aluminum target. The method is a time-resolved technique (TRT), in which a series of measurements can be obtained within a single ion beam pulse of several hundred microseconds duration. In this work, an optimized ion current is obtained by varying an extraction voltage as a function of

the extractor thickness and gap. The ratio of secondary electron current to incident ion current was determined using a new type Faraday cup (Fc) with conical suppressor controlled by a programmable delay system via the Time-Resolved System (TRS).

The TRT allows obtaining average charge yields of multiple charge state of titanium and copper ions. The yield of singly charge state carbon ions impinge on aluminum target is in good agreement with those reported by other authors (Alonso et al, 1980). The method of solving the secondary electron emission yield induced by multiple charged ions has been proposed for further development.



ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การพัฒนาแหล่งกำเนิดไฮอนโลหะพลังงานสูงชนิด
อาร์กในสุญญากาศ เพื่อสร้าง เทคโนโลยีไฮอนอิมพเลก
เตชัน

ผู้เขียน
ปริญญา

นายยิ่งล้อ จือตุ้ป้า¹
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร. บรรจบ ยศสมบัติ
รศ. ดร. กอบวุฒิ รุจิรงคากุล
ดร. ยุ เหลียงเต็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อขับยกระดับและสมบูรณ์ของแหล่งกำเนิด ไฮอนโลหะ พลังงานสูงชนิดอาร์กในสุญญากาศ โดยการ หาเงื่อนไขที่เหมาะสม(ออปคิไนส์) ในการตึงกระ杂质ไฮอน และ ได้ศึกษาการใช้ เทคนิคไทน์รีไซล์ในการวัด ผลได้ของ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยะภูมิ โดยใช้แหล่งกำเนิดไฮอนผลิต ไฮอนของโลหะ เพื่อใช้ในการวัดผลได้ของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยะภูมิ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชน ของ ไฮอนของคาร์บอน ไทด์เนียม และทองแดงบนเปลือกภูมิเนียม การออปคิไนส์ แหล่งกำเนิด ไฮอนในงานวิจัยนี้กระทำโดยการวัดกระ杂质ไฮอนที่ขึ้นกับแรงดัน ความ หนาและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าดึง ได้ทำการวัดอัตราส่วนระหว่างกระ杂质

อิเล็กตรอนทุติยะภูมิ และกระแสของไอออนที่วิ่งชนเป้าด้วยฟาราเดี้ยคัพ ชนิดใหม่ที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ขัดอิเล็กตรอนนั้นควบคุม ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคไนโตรเจล์ ช่วยให้สามารถวัดกระแสไอออนหลายค่าภายในช่วงของพัลส์ ที่มีความยาวหลายร้อยไมโครวินาที และช่วยในการวัดเพื่อหาค่าผลได้เฉลี่ยของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยะภูมิของ ไอออนที่มีประจุ หลายสถานะของไกเทเนียมและทองแดง ผลได้จากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยะภูมิของ ไอออนคาร์บอนสถานะประจุเดียวที่ชนกับเปลือกมุนีเนียมที่ทำการวัดมีความสอดคล้องกับผลการทดลองที่มีรายงานไว้ (อาลอน โซ และคณะ 1980) นอกจากนั้น ได้มีการเสนอวิธีการแยกผลได้ของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยะภูมิที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชนของ ไอออนหลายประจุเพื่อการพัฒนาต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved